

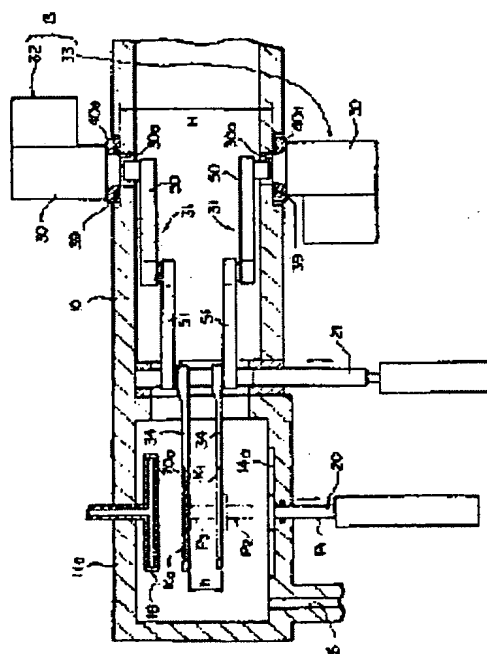
BASE BOARD CONVEYER

Patent number: JP4087785
Publication date: 1992-03-19
Inventor: KOJIMA KENICHI
Applicant: PURAZUMA SHISUTEMU:KK
Classification:
 - international: B25J9/06; H01L21/68
 - european:
Application number: JP19900201703 19900730
Priority number(s):

Abstract of JP4087785

PURPOSE: To substantially reduce a time for conveying a base board so as to remarkably improve throughput of a base board processor by vertically arranging robots so that one side surfaces of a driving part are opposed to each other.

CONSTITUTION: Robots 32, 33, comprising driving parts 30 and arm parts 31 actuated along one side surfaces 30a of these driving parts 30, are arranged, and base boards K0, K1 are placed and moved on hands 34 provided in top ends of the arm parts 31. Here, the robots 32, 33 are vertically arranged so that the one side surfaces 30a are opposed to each other. In this way, a time for conveying the base boards K0, K1 can be remarkably shortened almost simultaneously in/out handling the base boards K0, K1 by using the upper and lower robots 32, 33 even in whatever direction a processing chamber or a cassette is arranged relating to a conveyer.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-87785

⑬ Int. Cl.⁵

B 25 J 9/06
H 01 L 21/68

識別記号

庁内整理番号

D 8611-3F
A 8624-4M

⑭ 公開 平成4年(1992)3月19日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全11頁)

⑮ 発明の名称 基板搬送装置

⑯ 特 願 平2-201703

⑰ 出 願 平2(1990)7月30日

⑱ 発 明 者 小 島 健 一 東京都国立市谷保992 株式会社プラズマシステム内

⑲ 出 願 人 株式会社プラズマシ
テム 東京都国立市谷保992

⑳ 代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

基板搬送装置

2. 特許請求の範囲

駆動部と旋転部の一側面に沿って動作するアーム部とよくなるロボットを備え、前記アーム部の先端に設けられたハンドに基板を載せて移動させる基板搬送装置であって、

前記一側面が相対向するようにして上下に前記ロボットが配設されていることを特徴とする基板搬送装置。

3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、半導体基板等の基板に対してエッチング等の処理を施す処理装置における基板の搬送装置に関する。

「従来の技術」

周知のように、半導体製造技術においては、生産性を向上させるため半導体基板の大型化が進行

しており、シリコン単結晶技術の進歩に伴って5インチから8インチの大型程のものが出現している。また、液晶ディスプレイも大型なものの需要が高まっており、大型の液晶基板が増加しつつある。

そして、このように半導体基板や液晶基板（以下、基板という。）が大型化すると、これら基板に対して例えばプラズマエッチングやプラズマエッチング等の処理を施す基板処理装置には、処理速度が均一でかつ高速であることが要求される。

このため、近年、この基板処理装置は、従来のバッチ式のものに代わって、上記のような性能に供れる枚置式のものが増えてきている。

枚置式基板処理装置とは、基板を一枚づつ処理する方式の基板処理装置のことであり、通常、処理が行われるチャンバと基板のロード・アンロード用カセットとを備えるものである。

そして、この種のプラズマ処理装置は、処理室とカセットとの間で基板を一枚づつ受け渡すための搬送装置を必要とするものであるが、従来、